

## 第 8 回学際物質科学研修コース:「微細加工」

種々の物質科学の応用技術を開発していくために、微細加工は有力なツールである。  
本研修コースでは、シリコン集積回路で行われている微細加工の基本技術の講義と実習を行う。

### 【コース内容】

講義：リソグラフィー技術、エッチング技術、薄膜形成の基礎

講師：山部(TIMS ハイブリッド機能コア・物理工学)

7月29,30日(水) 午前11時～17時 於 3F800(第三エリア F 棟 8階)

実習1：フォトリソグラフィーと成膜 於 3L104、VBL クリーンルーム

シリコン酸化膜・AL 薄膜の形成とフォトリソグラフィー

指導：蓮沼 (TIMS ハイブリッド機能コア・物理工学)

実習2：電子線リソグラフィー 於 総合 B022 TIMS クリーンルーム

パターン設計、電子線描画、走査型電子顕微鏡による観察

指導 大塚 (TIMS 量子制御コア・物理)

※実習の日程は後日決定します。実習の一方のみの受講も可。

※なお、講義は電子・物理工学専攻の授業「ナノ加工・計測序論とファクトリー実習」  
を兼ねます。

【主 催】 筑波大学戦略イニシアティブ(A)「学際物質科学研究拠点」  
学際物質科学研究センター

【参加費】 無料

【申込方法】 (1) 氏名, (2) 一般・学生・研究員の別, (3) 所属, (4) 連絡先, (5) 自身の研究内容との関連や期待 (簡単に) を明記して山部 (yamabe@esys.tsukuba.ac.jp) まで E-mail でお申し込み下さい。なお、受け入れ可能人数を越えた申込みがあった場合は、(5) などを参考に可否を決めます。

【申込〆切】 7月13日(月) 17:00

【問合せ先】 山部紀久夫 (TIMS、物理工学系、内線：6475、yamabe@esys.tsukuba.ac.jp)  
あるいは、大塚洋一 (TIMS、物理学系、内線：4217、ootuka@lt.px.tsukuba.ac.jp)